

**АННОТАЦИЯ**  
к рабочей программе дисциплины  
**Б1.В.17 «Основы лучевых и плазменных технологий»**

<b>Направление подготовки</b>	11.03.04 «Электроника и наноэлектроника»
<b>Профиль</b>	«Микроэлектроника и твердотельная электроника»
<b>Квалификация (степень) выпускника:</b>	бакалавр
<b>Форма обучения</b>	очная / заочная
<b>Срок освоения образовательной программы</b>	4 года / 4 года и 11 мес.
<b>Год начала подготовки</b>	2018

**Цель изучения дисциплины:**

- изучение процессов взаимодействия потоков частиц и плазмы с конденсированными средами, используемых в лучевых и плазменных технологиях при производстве изделий электронной техники;
- овладение методами расчета и проектирования технологических лучевых и плазменных модулей;
- получение первичных навыков работы на лучевых и плазменных технологических установках.

**Задачи изучения дисциплины:** ознакомить студентов с процессами, которые лежат в основе методов сухого травления, с модификациями установок и рабочими газами.

**Перечень формируемых компетенций:**

**ПК-2:** способность аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения;

**ПК-7:** способность идентифицировать новые области исследований, новые проблемы в сфере физики, проектирования, технологии изготовления и применения микроэлектронных приборов и устройств.

**Общая трудоемкость дисциплины (з.е.): 3.**

**Форма итогового контроля по дисциплине:** зачет